

No.06-63 講習会
電子写真技術のシミュレーション
(情報・知能・精密機器部門 企画)

開催日 2006年9月4日(月)10.30~17.00, 9月5日(火)10.30~16.30

会場 早稲田大学 大久保キャンパス 62号館大会議室
〔東京都新宿区大久保3-4-1/JR山手線「高田馬場」駅戸山口下車徒歩10分, 地下鉄東西線「高田馬場」駅下車徒歩12分, 西武新宿線「高田馬場」駅下車徒歩12分, JR山手線「新大久保」駅下車徒歩10分〕

趣 旨

カラープリンタなどに使われている電子写真技術の高性能化, 低価格化には目覚ましいものがありますが, その開発は, 経験と試行錯誤によるところが多く, シミュレーションを活用した開発は十分ではありません。この講習会では, 開発に携わっている技術者を対象に, 電子写真固有の問題をシミュレーションによっていかに解決するかを, すぐにも役立てられるよう, サンプルプログラムを利用して分かりやすく解説します。

プログラム

第1日〔2006年9月4日(月)〕

- 10.30~11.00 はじめに - 電子写真技術とシミュレーション 早稲田大学 川本 広行
- 11.00~12.00 放電場解析による帯電・潜像形成プロセスのシミュレーション (株)リコー 渡辺 好夫
(昼食 1時間)
- 13.00~14.30 電界解析による現像・転写プロセスのシミュレーション (株)リコー 門永 雅史
リコープリンティングシステムズ(株) 栗林 夏城
キヤノン(株) 仲野 正雄
- 14.30~15.20 磁界解析による現像プロセスのシミュレーション 富士ゼロックス(株) 中山 信行
リコープリンティングシステムズ(株) 栗林 夏城
- 15.20~16.30 個別要素法による現像・転写プロセスのシミュレーション キヤノン(株) 仲野 正雄
富士ゼロックス(株) 中山 信行
- 16.30~17.00 質疑応答 早稲田大学 川本 広行

第2日〔2006年9月5日(火)〕

- 10.30~12.00 伝熱解析による定着プロセスのシミュレーション 富士ゼロックス(株) 伊藤 朋之
(昼食 1時間)
- 13.00~14.15 紙送りプロセスのシミュレーション (株)リコー 竹平 修
- 14.15~15.45 現像剤の動的挙動計測技術 キヤノン(株) 平林 純
- 15.45~16.30 おわりに - 質疑応答 早稲田大学 川本 広行

定 員 60名, 申込み先着順により満員になり次第締め切ります。

聴 講 料

会員20,000円(学生会員4,000円), 会員外30,000円, 一般学生6,000円。いずれも教材1冊分代金を含みます。開催日の10日前までに聴講料を着金するようにお申し込み下さい。以降は定員に余裕がある場合, 当日受付をいたします。なお, 聴講券発行後は取消しのお申し出がありましても聴講料は返金できませんのでご注意ください。

教 材

教材のみご希望の方, または聴講者で教材を余分にご希望の方は1冊につき, 会員3,000円, 会員外4,000円にて頒布いたします。講習会終了後は教材を販売いたしませんので, 開催前に代金を添えて予約申込み下さい。講習会終了後に発送します。

申込方法

本会ホームページのオンライン申込み(<http://www.jsme.or.jp/kousyu2.htm>)をしていただくか, 同ホームページの行事申込書フォーム(<http://www.jsme.or.jp/gyosan0.htm>)をダウンロードしていただき, 申込者1名ごとに必要事項を記入の上代金を添えてお申し込み下さい。

(担当職員 井上 理)